

平坦化CMP加工サービス

多様な平坦化に挑戦するCMP加工サービス

MATでは、あらゆる分野での平坦化CMP加工を行います。

プロセス条件が
わからない

初めての材料なので
平坦化できるのか
わからない

平坦化をしたいが
装置を持っていない

平坦化したいが
量が足りない

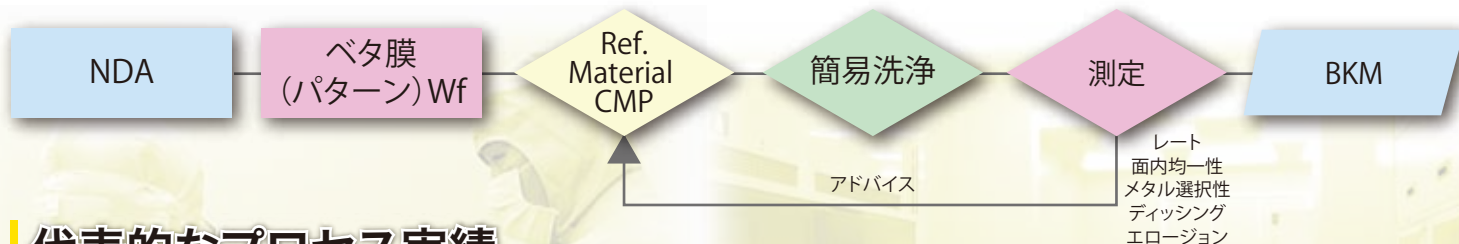
**MATのCMP加工サービスに
ご相談ください**

- 研究開発用デバイスのサンプル基板の製作
CMPプロセスの設計を目的とした平坦化を必要とするデバイスのサンプル品を製作いたします。
- 研削による薄片化基板の製作
弊社高精度グラインダーによりφ300mmまでの基板を研削加工いたします。
仕上りの厚みはお客様のご希望にあわせ製作し、研削での鏡面仕上げ～Polishによる鏡面加工+洗浄仕上げまで承ります。
- 平坦化に開発した副資材の実験評価
CMPスラリーやパッド、洗浄液、研削用砥石などのご開発製品の試験テストを承ります。
リアルタイムで加工後評価を行い、CMPプロセスのアドバイスも致します。
- 受託加工サービス
プロセス設計から受託加工まで一括して承ります。加工枚数は少数～多数までお客間のご希望に合わせて対応して参ります。



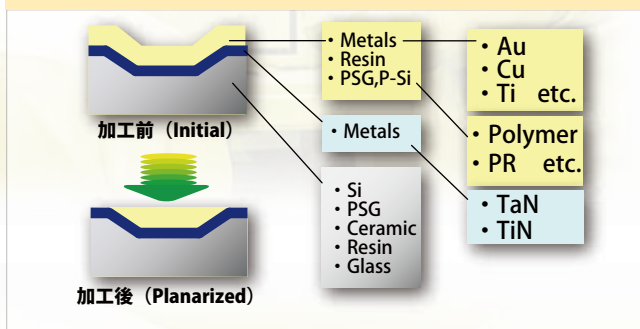
φ2”~φ300mmFTD/LCD, MEMS, 硝子, 結晶, 化合物等 あらゆる物の平坦化を行います。

評価フロー

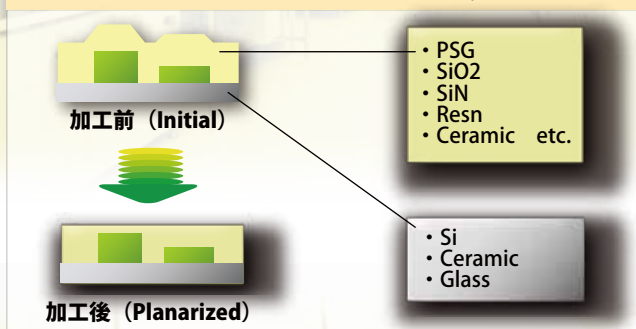


代表的なプロセス実績

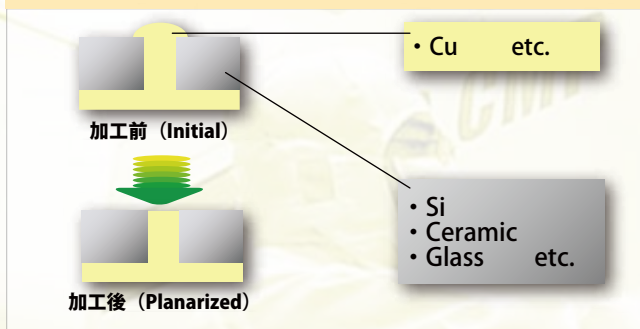
Case1 (トレンチへの埋め込み平坦化: ダマシンプロセス)



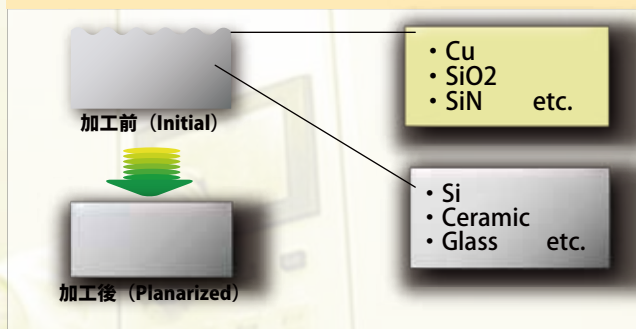
Case2 (初期段差の平坦化: 層間膜の平坦化)



Case3 (貫通メタル配線の平坦化)



Case4 (面粗さの向上)



MAT設備リスト

	種別	メーカー	機種名	対応Wf	機能
加工機	CMP実験装置	MAT	MAT ARW-681MK II	4,5,6,8	φ100スキャンドレス 卓上型
	CMP実験装置	MAT	MAT BC-15C	チップ4,5,6	
	CMP実験装置	MAT	MAT ARW-8C1MS		
	CMP実験装置	MAT	MAT Polish Analyzer		
		MAT	MAT GYR300-S	最大径φ300mm	
		MAT	MAT X-Section Analyzer		
洗浄装置	洗浄実験装置	MAT	MAT ZAB-8S1M	~8	純水のみ
	洗浄実験装置	MAT	MAT SPN-8M	8	
測定機	金属膜厚計	NAPSON	RT-80 RG-120	~12	触診2μm&サブミクロン AUTO LOADER付
	段差計	KLA Tencor	P16	~8	
	Wf厚み測定器	ADE	ULTRA GAGE 9500	4,5,6,8	
	光学顕微鏡	OLYMPUS	BH2-UMA		
	集光灯	ADE	ULTRA GAGE 9500		
	レーザー顕微鏡	KEYENCE	VK-8500	~8	
	ハイトゲージ	Nikon	MF1001	~12付近	
	表面構造解析装置	Canon	Zygo New View200		
光学膜厚計	MAT	モエギ	~8		

MAT Inc.
Machine Application Tools



株式会社 エム・エー・ティ

本社 東京都板橋区舟渡3-5-8板橋区第一工場ビル402号

テクニカルラボ 東京都板橋区蓮根3-22-7

TEL:03-5914-6355 FAX:03-5914-6356

Mail:acc@j-mat.co.jp URL:http://www.j-mat.co.jp